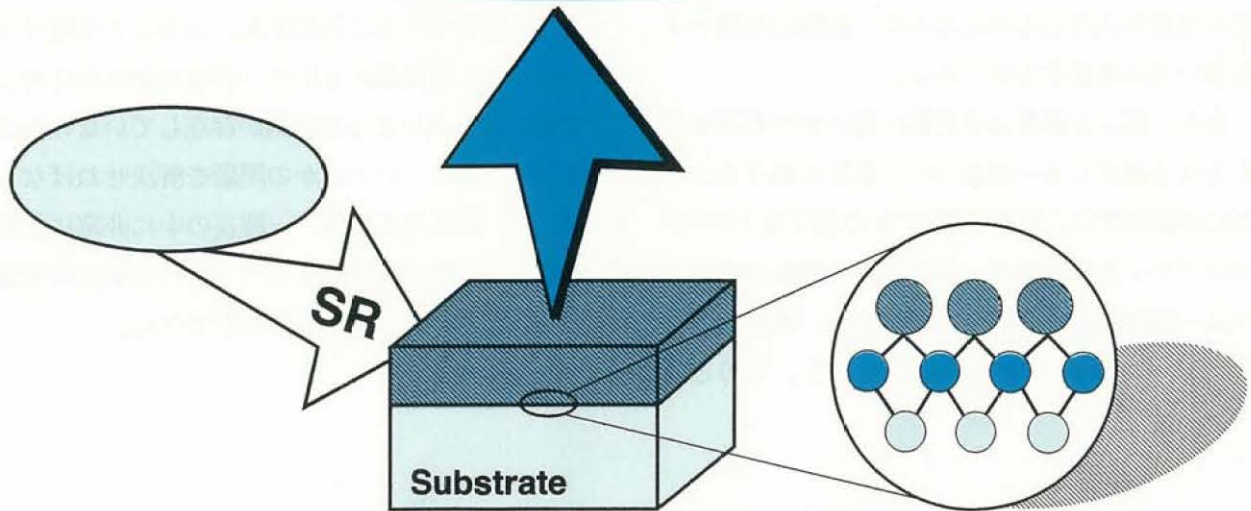


— 界面の世界に“光”をあてる! —

放射光フォーラム '93



日時：平成**5**年**11**月**5**日（金）

午前10時～午後5時10分まで

場所：東京大学山上会館大会議室（2階）

東京都文京区本郷7-3-1 TEL 03-3812-2111（代表）

主催：日本放射光学会

協賛：物理学会、応用物理学会、結晶学会、結晶成長学会、
生物物理学会

特別講演

in-situ X線回折による OMVPE 環境下での GaAs 成長 Real Time 観察
P.H.Fuoss 博士（AT&T Bell 研究所）

講演

放射光表面・界面解析概論
デバイスから見た表面・界面
X線異常分散を利用した界面構造解析
— 回折から“DAFS”まで —
表面光励起プロセス
半導体表面、超格子、混晶の微視構造
— 成長機構を探る新しい表面 XAFS —
パネル討論

太田 俊明氏（東京大学理学部）
榊 裕之氏（東京大学先端研）
水木純一郎氏（NEC・基礎研究所）

英 貢氏（豊橋技科大学）
大柳 宏之氏（電総研）

参加費：放射光学会会員（一般：4,000円 学生：2,000円）
非会員（一般：6,000円 学生：2,000円）

参加申込先／〒122 文京区小石川2-3-4
アイオニクス隣内 日本放射光学会事務局
TEL. 03-3812-0920 FAX. 03-3812-3997

本件問い合わせ先：尾嶋 正治（NTT・境界領域研究所） TEL. 0422-59-3167 FAX. 0422-59-3576

[FAXでお申込下さい。]

日本放射光学会事務局 宛

FAX 03-3812-3997

【TEL 03-3812-0920】

『放射光フォーラム'93』
—界面の世界に“光”をあてる!—
参加申込書

お名前 ① _____ ② _____ ③ _____

④ _____ ⑤ _____ ⑥ _____

ご所属 (部, 課, 科) ① _____

連絡先

ご住所 ① 〒 _____

TEL ① _____ (内線) _____

FAX ① _____

※複数の方がご参加の場合は、参加者全てのお名前をご記入下さい。(①～⑥)

バックナンバー紹介

日本放射光学会特別シンポジウム予稿集 (1991年1月)

Part 1 小型光源加速器の現状と展望—リソグラフィへの出番は？

Part 2 ソ連の放射光新技術

主催 日本放射光学会 後援 電子技術総合研究所

協賛 応用物理学会

体裁 A4判 (全英文, 2分冊) Part 1 B5判, Part 2 (OHP集)

定価 Part 1, 2, とも各1,000円

内容

Part 1 Status and Prospects of Compact Synchrotrons

May we expect their turn for lithography?

Current Techniques of Lithography

1. Survey of Advanced Microdevice Technology..... S. Namba (Osaka Univ.)
2. The state-of-the-Art ULSI Fabrication Technologies..... S. Asai (Hitachi)
3. Electron-beam Patterning Techniques..... H. Yasuda (Fujitsu)
4. Recent Progress in Optical Lithography..... M. Nakase (Toshiba)

Synchrotron Radiation Lithography

5. SR Lithography in NTT..... H. Yoshiwara (NTT)
6. X-ray Lithography for Quarter Micron Application..... J. Trube et al (IMT)
7. Low Energy Proximity X-Ray Lithography..... K. Suzuki (NEC)
8. SR Lithography at SORTEC..... N. Atoda et al (SORTEC-ETL)

Status Reports on Compact Synchrotrons

9. Development of Compact SR Rings for Industrial Use in Japan..... T. Tomimasu (ETL)
10. Present Status of Helios..... T. Ford (Oxford Instr.)
11. Super ALIS: A Superconducting Compact Storage Ring..... T. Hosokawa et al (NTT)
12. X-ray Lithography Using SR in the USSR and Further Development
in the Dedicated SR Source "Zelenograd"..... S. Mazurenko (Zelenograd)
13. Status of SORTEC 1-GeV Ring..... M. Kodaira et al (SORTEC)
14. Status of the Superconducting X-Ray Lithography Source (SXLS) at BNL..... J. Murphy et al (NSLS)

Afternoon: Extended Uses of Compact Synchrotrons beyond Lithography

15. Program of Compact SR Sources Creation in the USSR..... N. Mezentsev (INP)
16. Research Program of CAMD (Center for Advanced Microstructures and Devices)..... V. Saile (LSU)
17. Ideas for General-Purpose Synchrotron Radiation Source..... H.O. Moser (KfK)

申込先 日本放射光学会事務局 〒112 文京区小石川2-3-4 川田ビル アイオニクス(株)内
TEL 03-3812-0920 FAX 03-3812-3997